

計測分析に関する講演会 「工業材料の表面分析事例」

～飛行時間型二次イオン質量分析、X線光電子分光、オージェ電子分光～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団

今年2月14日、付加価値の高いモノづくりを支援する研究開発拠点である「知の拠点」に、「あいち産業科学技術総合センター」がオープンしました。当センター本部には、種々の高度分析機器が整備され、企業の研究開発・製品開発の支援のため利用されています。

このたび、整備した機器のうち、飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)、X線光電子分光(XPS)及びオージェ電子分光(AES)※による、工業材料の表面分析に焦点を当てた講演会を、当センター本部にて10月5日(金)に開催します。これらの分析装置は、金属、セラミックス、プラスチックの表面分析ができる装置で、分析対象としては固体材料はもちろんフィルム、CVD膜やスパッタ膜なども利用可能です。防錆、めっき、有機化、酸化や窒化などの表面処理の組成分析、化学種や化学状態の分析を行うことができます。表面の化学情報は新規材料の開発、新規製品のプロセスの最適化、異物検査などの品質管理に役立ちます。

講演後には、当センターの分析機器及び隣接する中部シンクロトン光利用施設(仮称)の見学会を行います。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日 時】平成24年10月5日(金) 午後1時30分～午後5時

【場 所】あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 13:40	開会の挨拶
13:40 ~ 14:40	「TOF-SIMSによる工業用材料表面の組成解析」 株式会社豊田中央研究所 主席研究員 <small>むらせ あつし</small> 村瀬 篤 氏
14:50 ~ 15:50	「X線光電子分光(XPS)、オージェ電子分光(AES)による最新表面分析応用事例」 アルバック・ファイ株式会社 市場開発部 部長 <small>さなだ のりあき</small> 真田 則明 氏
16:00 ~ 17:00	施設見学(希望者のみ) ・共同研究支援部 計測分析室 飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)、X線光電子分光(XPS)、オージェ電子分光(AES)の他、透過電子顕微鏡、核磁気共鳴装置など ・中部シンクロトン光利用施設(仮称)

※平成22年度先端技術実証・評価設備整備等補助金(愛知県と(公財)科学技術交流財団の共同事業)により整備

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成24年10月4日（木）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込先及び問い合わせ先**

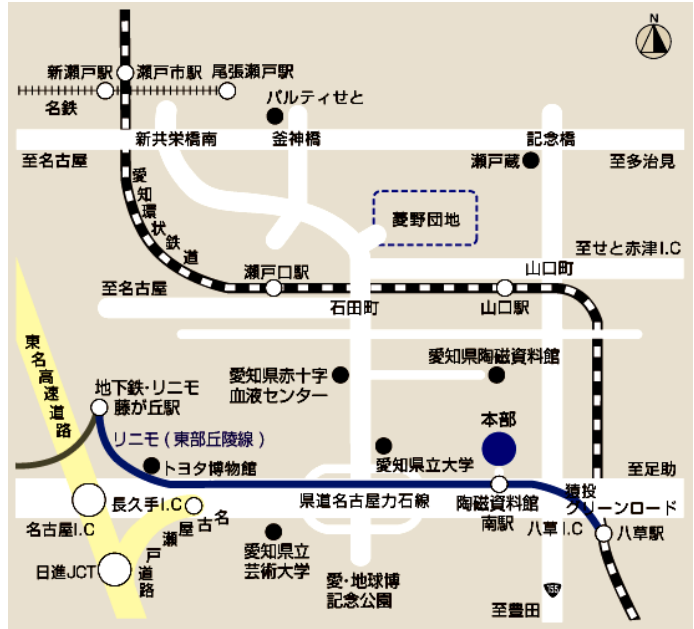
あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 計測分析室 中尾、加納

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

U R L：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「工業材料の表面分析事例」
参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 中尾、加納 宛
FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい)	参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。